



测量系统光源：

带具有恒流源的5毫瓦半导体激光器

仪器尺寸：

520 × 300 × 200(u : mm)

可开设实验：用光纤压力传感器测金属材料的杨氏模量(压气加载法)用光纤位移传感器测金属的杨氏模量(弯曲法)光纤压力位移传感器特性的研究光纤位移传感器特性研究高斯光束变换及参数测定等。